

走査プローブ技術または装置; 走査プローブ技術の応用, 例. 走査プローブ型顕微鏡 [SPM] [2010. 01]

注

このサブクラスにおいては、ファーストプレイス優先ルールが適用となる、すなわち各階層レベルにおいて、相反する指示がない限り、最初の適切な箇所に分類する。[2010. 01]

- 10/00 走査または位置決め装置, すなわち, プローブの動きあるいは位置を積極的に制御するための装置 [2010. 01]
- 10/02 ・粗動走査または粗動位置決め [2010. 01]
- 101 ・・圧電素子を用いたもの
- 111 ・・それらのための回路またはアルゴリズム
- 10/04 ・微動走査または微動位置決め [2010. 01]
- 101 ・・圧電素子を用いたもの
- 10/06 ・・それらのための回路またはアルゴリズム [2010. 01]
- 20/00 プローブの動きまたは位置の監視 [2010. 01]
- 20/02 ・光学的手段によるもの [2010. 01]
- 20/04 ・自己検知プローブ, すなわち, プローブ自身がその位置を示すような信号を発するもの, 例. 圧電ゲージ [2010. 01]
- 30/00 走査プローブ技術または装置の補助または改良に資する補助的手段, 例. 表示装置またはデータ処理装置 [2010. 01]
- 30/02 ・非 SPM 分析装置, 例. SEM [走査型電子顕微鏡], 分光計または光学顕微鏡 [2010. 01]
- 30/04 ・表示装置またはデータ処理装置 [2010. 01]
- 30/06 ・・エラー補償のためのもの [2010. 01]
- 30/08 ・サンプルチェンバー内に所望の環境条件を確立し調節するための手段 [2010. 01]
- 30/10 ・・温度環境 [2010. 01]
- 30/12 ・・流体環境 [2010. 01]
- 30/14 ・・・液体環境 [2010. 01]
- 30/16 ・・真空環境 [2010. 01]
- 30/18 ・外部の環境条件または影響からサンプルチェンバーの内部を保護しあるいは隔離するための手段 [2010. 01]
- 30/20 ・試料の取扱装置または手段 [2010. 01]
- 40/00 キャリブレーション, 例. プローブのキャリブレーション [2010. 01]
- 40/02 ・キャリブレーションの基準またはその製造方法 [2010. 01]
- 60/00 特定の型の SPM [走査プローブ型顕微鏡] またはそのための装置; その基本的な構成部品 [2010. 01]
- 101 ・プローブの特性
- 60/02 ・マルチタイプ SPM, すなわち 2 つまたはそれ以上の SPM 技術を使用するもの [2010. 01]

- 60/04 ・・STM [走査型トンネル顕微鏡法] と AFM [原子間力顕微鏡法] の組合せ [2010. 01]
- 60/06 ・・SNOM [近視野光学顕微鏡法] と AFM [原子間力顕微鏡法] の組合せ [2010. 01]
- 60/08 ・・MFM [磁気力顕微鏡法] と AFM [原子間力顕微鏡法] の組合せ [2010. 01]
- 60/10 ・STM [走査型トンネル顕微鏡法] またはそのための装置, 例. STM 用プローブ [2010. 01]
- 60/12 ・・STS [走査型トンネルスペクトロスコピー] [2010. 01]
- 60/14 ・・STP [走査型トンネルポテンショメトリ] [2010. 01]
- 60/16 ・・プローブまたはその製造または関連する器具類, 例. プローブホルダー [2010. 01]
- 101 ・・・プローブの特性
- 111 ・・・プローブの製造
- 60/18 ・SNOM [近視野光学顕微鏡法] またはそのための装置, 例. SNOM 用のプローブ [2010. 01]
- 60/20 ・・蛍光 [2010. 01]
- 60/22 ・・プローブまたはその製造または関連する器具類, 例. プローブホルダー [2010. 01]
- 101 ・・・プローブの特性
- 111 ・・・プローブの製造
- 60/24 ・AFM [原子間力顕微鏡法] またはそのための装置, 例. AFM 用のプローブ [2010. 01]
- 60/26 ・・摩擦力顕微鏡法 [2010. 01]
- 60/28 ・・凝着力顕微鏡法 [2010. 01]
- 60/30 ・・走査型ポテンシャル顕微鏡法 [2010. 01]
- 60/32 ・・AC モード [2010. 01]
- 60/34 ・・・タッピングモード [2010. 01]
- 60/36 ・・DC モード [2010. 01]
- 60/38 ・・プローブまたはその製造または関連する器具類, 例. プローブホルダー [2010. 01]
- 101 ・・・プローブの特性
- 111 ・・・プローブの製造
- 60/40 ・・・導電性プローブ [2010. 01]
- 60/42 ・・・機能化 [2010. 01]
- 60/44 ・SICM [走査型イオンコンダクタンス顕微鏡法] またはそのための装置, 例. SICM 用のプローブ [2010. 01]
- 101 ・・プローブまたはその製造または関連する器具類, 例. プローブホルダー
- 60/46 ・SCM [走査型キャパシタンス顕微鏡法] またはそのための装置, 例. SCM 用のプローブ [2010. 01]
- 60/48 ・・プローブまたはその製造または関連する器具類, 例. プローブホルダー [2010. 01]
- 60/50 ・MFM [磁気力顕微鏡法] またはそのための装

- 置, 例. MFM 用のプローブ [2010. 01]
- 60/52 ・ ・ 磁気共鳴 [2010. 01]
- 60/54 ・ ・ プローブまたはその製造または関連する器具類, 例. プローブホルダー [2010. 01]
- 101 ・ ・ ・ プローブの特性
- 111 ・ ・ ・ プローブの製造
- 60/56 ・ ・ ・ 磁気コーティングされたプローブ [2010. 01]
- 60/58 ・ SThM[走査型熱顕微鏡法]またはそのための装置, 例. SThM 用のプローブ [2010. 01]
- 60/60 ・ SECM[走査型電気化学顕微鏡法]またはそのための装置, 例. SECM 用のプローブ [2010. 01]
- 101 ・ ・ プローブまたはその製造または関連する器具類, 例. プローブホルダー
- 70/00 SPM プローブの一般的観点またはその製造または関連する器具類で, グループ G01Q60/00 に包含される単一の SPM 技術に特に適合していないもの [2010. 01]
- 70/02 ・ プローブホルダー [2010. 01]
- 70/04 ・ ・ 温度・震動に誘引されたエラーの補償のあるもの [2010. 01]
- 70/06 ・ プローブチップアレイ [2010. 01]
- 70/08 ・ プローブの特性 [2010. 01]
- 70/10 ・ ・ 形状またはテーパ [2010. 01]
- 70/12 ・ ・ ・ ナノチューブチップ [2010. 01]
- 70/14 ・ ・ 特定の物質 [2010. 01]
- 70/16 ・ プローブの製造 [2010. 01]
- 70/18 ・ ・ 機能化 [2010. 01]
- 80/00 SPM を除く走査プローブ技術の応用 (マイクロ構造の製造または処理 B81C; ナノ構造物の製造または処理 B82B3/00; 近接場相互作用を用いる情報の記録と再生 G11B9/12, G11B11/24, G11B13/08) [2010. 01]
- 101 ・ 情報記録装置への適用
- 111 ・ 表面加工への適用
- 121 ・ 生物試料への適用
- 90/00 他に分類されない走査プローブ技術または装置 [2010. 01]